PAT-NO:

JP363222023A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63222023 A

TITLE:

PRODUCTION OF OPTICAL ELEMENT

PUBN-DATE:

September 14, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

YAMAMOTO, KIYOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

CANON INC

N/A

APPL-NO:

JP62055192

APPL-DATE:

March 12, 1987

INT-CL (IPC): C03B011/00, B29D011/00, B29C043/02

US-CL-CURRENT: 425/808

ABSTRACT:

PURPOSE: To readily produce an optical element such as lens or prism having concave and convex shape or non-spherical surface at a short time in good productivity, by arranging a raw material for optical element molding coated with carbon thin film into a mold for molding and molding the raw material under pressure.

CONSTITUTION: Chemically stable carbon thin film 21 having excellent uniformness and strength and free from melting with a mold for molding is applied to faces 22a and 22b for molding functional face of a glass raw material for optical element molding formed to a prescribed shape by treatment such as granding, polishing or melt solidification so as to have 1∼ 100nm thickness by spattering, etc. Then the carbon thin 11 21-coated raw material 22 is arranged in the mold for molding and heated and molded under pressure and then subjected to annealing treatment in order to burn and remove the carbon thin film to provide the desired optical element (e.g. convex lens) 32.

COPYRIGHT: (C)1988, JPO& Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-222023

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

码公開 昭和63年(1988) 9月14日

C 03 B 11/00 B 29 D 11/00 B 29 C 43/02 B 29 L 11:00 B-7344-4G 6660-4F 7639-4F

iF 審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

光学素子の製造方法

本

②特 願 昭62-55192

29出 願 昭62(1987)3月12日

砲発 明 者 山

潔

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

⑪出 願 人 キャノン株式会社

⑩代 理 人 弁理士 山下 穣平

明 細 盲

1. 発明の名称

光学素子の製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 子め機能面が成形される面に皮浆機膜が被膜された成形可能な状態の光学案子成形用来材を、成形用型内に配置し、該型により前記光学案子成形用素材を加圧して光学素子の機能面を成形する工程を含むことを特徴とする光学素子の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

〔発明の利用分野〕

本発明は凸レンズ、凹レンズ、フレネル、非球面レンズ、プリズム、フィルター等の光学業子の製造方法に関する。

〔従来の技術〕

レンズ、プリズム、フィルター等の光学業子の多くは、従来ガラス等の業材の研摩処理を主とした方法によって成形されてきた。しかしながら、このような研摩処理を主とした成形法に於いては、相当な時間及び熟練技術が必要とされ、特に非球面レンズを研摩処理によって成形するには、一層高度な研摩技術が要求されまた処理時間も更に長くなり、短時間に大量に製造することは非常に困難であった。

そとで、例えば一対の成形用型内に光学業子成形用案材を挿入配置し、これを加圧するだけでレンズ等の光学案子を簡易に生産性良く成形する方法が注目されている。

代表的な加圧成形法としては、高精度の光学素

(1)

(2)

子を成形できる方法としてリヒートプレス法が挙 げられる。

リヒートプレス法は、予め溶融固化した光学業子成形用素材として例えばガラス素材の必要を計り取り、これを所定の温度に加熱して、軟化で、投入したれを加圧、投入したがラス素材をである。また、特開昭47-11277には、予め溶融固化したガラス素材をの形用型内に投入し、カラス素材を成形でれた状態になったところでこれを加圧に状態が成形されたガラスレンズを成形する方法が開示された分

このよりな加圧成形法を適用することによって、 従来の研摩処理を主とした成形法と比べて光学素 子を短時間に容易に成形することが可能となり、 特に成形に於ける難易性の高かった非球面を有す る光学案子を容易に成形できるようになった。 [発明の解決すべき問題点]

ところが、加圧成形法によって光学案子を成形(3)

た機能面に繰りのない光学案子を、光学案子成形 用素材を成形用型によって加圧するだけで簡易に 生産性良く成形することのできる光学素子の製造 方法を提供することにある。

[問題点を解決するための手段]

すなわち本発明の光学素子の加圧成形法は、予め機能面が成形される面に炭素薄膜が被膜された成形可能な状態の光学案子成形用素材を成形用型内に配置し、該型により前配光学素子成形用素材を加圧して光学素子の機能面を成形する工程を含むことを特徴とする。

本発明の方法に於いては、光学素子を加圧成形する前の所望の段階に於いて、予め機能面が成形される光学素子成形用素材の面に炭素薄膜が被膜される。

以下、図面を参照しつつ本発明の方法をガラス 製凸レンズの成形をその一例として詳細に説明す

第1図は、本発明の方法に使用することのできる光学素子の加圧成形装置の一例である。

した場合、成形された光学案子の形状については 所定の精度を得ることができるが、成形された光 学案子の機能面の曇りや融着が生じ易く、光学的 機能については必ずしも充分なものを得ることは できなかった。

この機能面の曇りは、加圧成形の過程に於いて 光学案子成形用素材とこれを加圧成形する型の面 とが高温で比較的長時間密着した状態で接触する ため、微小部分に於いて前配素材と型の面を 着し、成形後に型から成形された光学案子を難型 する際に、案材要面の型との微細融着部分が型要 面に融着したまま残されることによって成形面に 生じるピンホールや微細な凹み等の欠陥によって 形成されるものである。

これらの欠陥は型材の種類を問わず光学素子の 加圧成形された面に生じるため、加圧成形法に於 いては避けられない問題となっていた。

本発明はこのような問題に鑑みなされたものであり、その目的は、型と成形された光学素子の融 着を防ぎ、所定の状形及び精度を有し、成形され

(4)

1 はベルジャー本体、2 は蓋、3 は光学案子の 第1の機能面を成形するための面を有するための面を有するための面を を有する下型、5 は上型3 を保持し押えるための 押え、6 は胴型、7 はホルダー、8 は成形装置 を を加熱するためのとーター、9 は下型4 を突き上げて加圧するための加圧棒、1 0 は加圧棒 9 を 即させるためのエアーシリンダー、1 1 は油 用ポンプ、12、13、14、16、18 はベルブ、15 は不活性ガス流入用ペイプ、1 7 は不活性ガス 気用ペイプ、1 9 は温度センサー、2 0 は装置内 を冷やすための水冷パイプである。

本発明の方法に従って凸レンズを成形するにはまず、第2図に示すように、研削、研摩あるいは溶験固化等の処理により所定の形状に成形された所定容量の光学ガラスからなる業材(ガラス素材)22の機能面が成形される面22a及び22bに炭素薄膜21を被膜する。

本発明の方法に於いて被膜される炭素薄膜は、主に成形工程を通じて光学素子成形用素材の機能面が成形される面を保護するとともに、該膜の表

(5)

面が成形用型と高温で比較的長時間密着した状態で接触しても、前述のガラス素材等に認られたよりな成形用型との接触面の微小部分に於ける融着を起さず、成形された光学素子に型からの良好な難型性を付与することを目的として設けられる。

従って、本発明の方法に於いて設けられる炭素 薄膜は、光学素子成形用素材上に均一で、保護膜 として十分な強度を有し、化学的にも安定であり、 更に、成形用型との前述したような融着を起さない 連続被膜を形成することのできる炭素材料から形 成される。炭素薄膜は、例えば成形後のアニール 工程等で燃焼させることにより、取り除くことが できる。

このような薄膜21を素材22の所定の面に被膜するには、上記のような薄膜形成用の材料を素材22の材質や形状等に合せて、例えば真空蒸着、スペッタリング、プラズマ CVD などの蒸着法や炭素粉末の分散液を用いた含浸法あるいは塗布法等の種々の被膜形成法を適宜使用して素材22の所定の面に所定の膜厚を積層することができる。

(7)

1内を徐々に冷却し、所定の温度にまで冷却されたところでパルプ16を閉じ、パルプ13を開いてペルプ16を閉じ、パルプ13を開いてペルジャー内に空気を導入し、蓋2をあけるととのできる程度にまで内圧が上ったら蓋2をあけるため、押え5を外して成形された第3四に示したるといった。その後、凸レンズ32を取り出す。その後、凸レンズ32を確保するため、アニール処理を行なか、光学特性を確保するため、アニール処理を行なか、光学特性を確保するため、消滅するため、第4四に示した様な凸レンズ32が得られる。

また、例えば、炭素薄膜21を不織布による仕上研摩の方法により剝離することもできる。得られた凸レンズ32の機能面の表面には前述したような従来問題となっていたピンホールや凹み等の徴細欠陥の発生は認められず、従って機能面には動かなく、凸レンズ32は所定の形状及び精度を有している。

なお、上配工程においての成形時の加圧の圧力、 加圧成形後の冷却の速度、時間、成形された光学 素子の取り出し温度等の操作条件は、使用する光 上配炭素薄膜の厚さは、 1 nm ~ 100 nm 程度で あることが好ましい。

次に、このようにして薄膜21が設けられた素材22をベルジャー1の蓋2をあけて下型4の上に軟置し、更に上型3を配置して蓋2を閉じ、水冷パイプ20に水を流し、ヒータ8に通電する。

このとき、不活性ガス用パルプ16、18及び 排気ペルプは閉じておく。なお、油廻転用ポンプ 11は常に作動させておく。

次に、パルプ 1 2 を開け排気を開始し、ペルジャー1内の圧力が約 10^{-2} Torr 程度以下になったところでパルプ 1 2 を閉じ、パルプ 1 6 を開いて不活性ガスとしての N_2 ガスをペルジャー 1 内に導入する。

ガラス素材 2 2 が成形可能な温度にヒーター 8 によって加熱されたところで、エアーシリンダー 1 0 を作動させて、加圧棒 9 を介して所定の圧力で下型 4 を押し上げてガラス案材 2 2 を上型 3 と下型 4 によって加圧し成形する。

最後にヒーター 8 を制御しながら、ベルジャー (8)

学案子成形用案材の材質、成形しよりとする光学 案子の精度等に応じて適宜選択することができる。

この例に於いては、凸レンズが本発明の方法により成形されたが、成形用上型 3 及び下型 4 を所望の形状及び精度を有する光学案子に対応した上型及び下型と代えることにより、凹レンズ、フレネル、非球面レンズ、プリズム、フィルター等の光学素子を成形することができる。

以上のような本発明の光学素子の製造方法によれば、光学案子成形用案材の被成形面に予め薄膜を設けたことにより、成形工程を通じて光学素子の機能面が保護され、かつ従来の加圧成形法に於いて認められたような案材の被成形面と成形用型との高温密着による微細部分に於ける融着を防ぐことが可能となり、型からの成形された光学案子の鑑型性が向上した。

従って、本発明の光学案子の製造方法によって成形された光学案子の機能面にはピンホールや凹み等の数細欠陥の発生は認められず、所定の形状及び精度を有し、曇りのない機能面からなる光学

(9)

紫子を得ることができる。

〔 爽 施 例 〕

以下、実施例を用いて本発明の方法を更に詳細に説明する。

奥施例1

まず、第2図に示すよりに光学案子成形用素材22としての円盤形状に研摩加工されたクラウンガラスの機能面の成形される面に通常の蒸着法により炭素薄膜(膜厚20nm)を形成させた。

次に、炭素薄膜が被形成面に設けられた素材22を第1図に示す装置の成形用型のモリプアン製の上型3と下型4の間に配置し、水冷パイプ20に水を流し、ヒーター8に通電した。

このとき、不活性ガス用パルプ16、18及び排気パルプ12は閉じ、油廻転用ポンプ11は常に作動させた。

なお、上型3の光学案子の機能面を形成する面は、外径17mm、曲率半径20mm、及び面精度、形状に於いてニュートンリング、ペワー3本以内不規則性1本以内、中心線平均表面粗さ(JISB

示したようなすでに2つの機能面に薄膜が設けられている凸レンズ32を取り出した。

最後に所定のアニール処理を行なりことによって、炭素薄膜 2 1 を取り除いた。

得られた凸レンズ32の機能面の表面を3750倍の走査型電子顕微鏡によって観察したところ、機能面にはピンホールや凹み等の微細欠陥の発生は認められず、従って曇りがなく、凸レンズ32は所定の成形用型の機能面を形成する面の形状及び精度に対応した形状及び精度を有したレンズであった。

比較例1

比較のために炭素薄膜を設けない以外は前記実施例と同様にして凸レンズを加圧成形した。

本比較例に於いて得られた凸レンズについても、その形成された機能面の表面を 3750 倍の走査型 電子顕微鏡により観察したととろ、機能面要面には微細なピンホールや凹みが表面一面に観察され、とのために本比較例に於いて得られたレンズの機能面は曇りのあるものとなり、製品として要求さ

(13)

0610-1970) 0.0 2 4 以内に凹面状に鏡面加工した。下型 4 の機能面を形成する面は外径 1 7 mm、曲率半径 5 5 mmに、また面精度は上型 3 と同程度に凹面状に鏡面加工した。

次に、パルプ 1 2 を開け排気を開始し、ペルジャー1 内の圧力が約 1 0^{-2} Torr 程度以下になったところでパルプ 1 2 を閉じ、パルプ 1 6 を開いて不活性ガスとしての N_2 ガスをベルジャー 1 内に導入する。

ガラス素材 2 2 が成形可能な 温度 (600 c) にヒーター 8 によって加熱されたところで、エアーシリンダー 1 0 を作動させて、加圧棒 9 を介して10 by/cm² の圧力で下型 4 を押し上げて 案材 2 2 を上型 3 と下型 4 によって 5 分間加圧した。

最後にヒーター 8 を削御しながら、ベルジャー 1 内を 1 時間にわたり徐々に冷却し、2000 以下 に冷却されたところでベルプ 1 6 を閉じ、ベルブ 1 3 を開いてベルジャー内に空気を導入し、蠆 2 をあけることのできる程度にまで内圧が上ったら 蓋 2 をあけ、押え 5 を外して成形された第 3 図に (12)

れる精度及び品質を満足するものとはならなかった。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の方法に使用される光学案子成形装置の一例の要部を示した模式図、第2図は、本発明の方法に使用される光学案子成形用素材の一例の模式的断面図、第3図は本発明の方法に於いて成形された炭素薄膜を機能面に有する光学案子の一例の模式的断面図、第4図は、本発明の方法によって成形された光学案子の一例の模式的断面図である。

1: ペルジャー本体、2: 蓋、

3:光学案子の第1の機能面を成形するための面を有する上型、

4:光学素子の第2の機能面を成形するため の面を有する下型、

5: 上型3を保持し押えるための押え、

(14)

6: 胴型、 7: ホルダー、

8:成形装置内を加熱するためのヒーター、

9: 下型 4 を突き上げて加圧するための加圧 棒.

--114*-*--

10:加圧棒9を作動させるためのエアーシリンダー

11:油姆転用ポンプ、

12、13、14、16、18 : パルナ、

15:不活性ガス流入用パイプ、

17:不活性ガス排気用ペイプ、

19:温度センサー、

20:装置内を冷やすための水冷パイプ、

2 1 : 炭素薄膜、

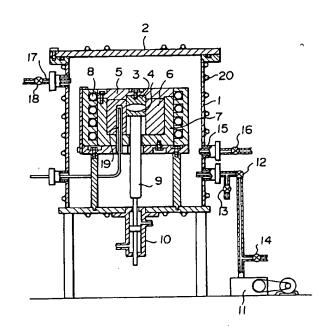
2 2 : 光学案子成形用素材、

22a、22b:機能面が成形される面、

32:成形された光学素子。

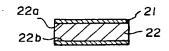
代理人 弁理士 山 下 穣 平

第1図

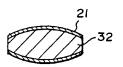


(15)

第 2 図



第 3 図



第 4 図

